

教職員・学生向け

参加無料

X線回折（粉末・薄膜）に関するセミナー

粉末回折法で測定の対象となるのは、粉末試料あるいは多結晶体、多結晶性の薄膜など広い範囲にわたります。粉末X線回折法については、粉末試料、多結晶性薄膜の測定、結晶子サイズ解析などを中心とした原理について解説します。また、薄膜X線回折法では、薄膜評価の基礎、特に Out of plane、In-plane、ロッキングカーブ、逆格子マップ、反射率について解説します。本セミナーでは、いくつかの分析事例を紹介しながら、これらの分析手法について具体的に紹介します。

【日時】平成26年10月2日(木) 13:00～17:00

【場所】大阪大学 理工学図書館 図書館ホール(吹田キャンパス)

【定員】100名

【対象者】初心者から(教職員、大学院生、学部4回生)

【講師】(株)リガク X線機器事業部 森谷洋治氏

プログラム

・13:00～14:40

「粉末および多結晶性薄膜の測定や結晶子サイズの解析」

「薄膜の Out-of-plane測定、In-plane測定、反射率測定」

・15:00～16:00

「エピタキシャル膜の逆格子マップ測定、ロッキングカーブ測定」

・16:00～17:00

「ナノ粒子の小角散乱の測定・解析」

参加方法

<http://www.reno.osaka-u.ac.jp/reuse-seminar-cam> より参加登録をお願いします。(要予約)

お問合せ先

科学機器リノベーション・工作支援センター 吹田地区

E-Mail : info@reno.osaka-u.ac.jp TEL : 06-6879-4781